紫外光面発光光源の開発と水処理技術

Development of Ultraviolet-Light-Emitting Light Source and Water Treatment Technology

佐	々 フ	卜 良	樹		頭	Л	武	5
Yoshiki Sasaki			Takehiro Zukawa					
長	尾	宣	明		神	子	直	~
Nobuaki Nagao					Naoyuki Kamiko			

武 央 黒 澤 iro Zukawa Takako Kurosawa 直 之

貴 子

要 旨

環境汚染の課題がある水銀を含まない光源として、物質分解用途に真空紫外光光源、殺菌用途に深紫外光光源 を開発した.真空紫外光光源は、基板の片面にサファイアガラスを用いることで、Xeガスの放電によって発生す る147 nmの共鳴線と172 nmの分子線の発光スペクトルをもつ真空紫外光を放出する. 深紫外光光源は, 真空紫外 光光源の内部に深紫外光に波長変換する蛍光体を設けることで、中心波長が232 nmのブロードな発光スペクトル をもつ深紫外光を放出する.真空紫外光光源は,汚染物質を想定した有機物であるインジゴカルミンに照射する の殺菌効果を確認し、殺菌光源として使用できることを示した.

Abstract

We developed a vacuum ultraviolet light source for material decomposition and a deep ultraviolet light source for sterilization applications as a mercury-free light source. The vacuum ultraviolet light source has peaks of two spectra derived from a resonance line of 147 nm and molecular line of 172 nm. The deep ultraviolet light source has a broad spectrum with a center wavelength at 232 nm and the full width at half maximum is 40 nm. The vacuum ultraviolet light source decomposed 67.1 % of the carbon component contained in indigo carmine into CO₂. Furthermore, the bactericidal effects of E. coli phage ϕ X174 and MS 2 were confirmed with a deep ultraviolet light source.

1. はじめに

近年の上水処理技術において、塩素消毒に耐性をもつ 病原性原虫クリプトスポリジウムによる集団感染を対策 するために、原水が地表水でない場合は水銀ランプによ る紫外線処理が導入されるようになった[1].また、下水 処理技術においても、染料などの難分解物質の処理のた めに水銀ランプを用いた分解処理が注目されている[2]. しかしながら、水銀は環境負荷への影響が大きいために 規制が厳しくなり、水銀を用いない新しい紫外光光源が 望まれている[3].

このような光源としては、小型で高い発光効率が期待 できるDUV-LED (Deep Ultraviolet-light Emitting diode) が注目されている[4]. しかし, 水処理用の紫外線光源は, 高い出力と大面積の処理が必要となるため、低圧水銀ラ ンプと同等の出力や発光面積を得るためにDUV-LEDを 多数整列させる必要があった[5].

筆者らは、上水処理における殺菌と下水処理における 難分解物質の分解のための、水銀を用いない新しい紫外 光光源の開発を行った.

本稿では、殺菌用の深紫外光光源と物質分解用の真空 紫外光光源の開発の概要と、開発した光源の特性および その殺菌・物質分解効果について報告する.

ここで, 真空紫外光は10 nm~200 nm, 深紫外光は

200nm~280 nmの波長をもつ紫外光をさす.

2. 紫外光光源の開発

2.1 提案する紫外光光源とその課題

筆者らは、水銀を使わない高出力で大面積の紫外光光 源を実現するために、PDP (Plasma Display Panel)の発 光原理に着目した. PDPは、希ガスの放電で生じる真空 紫外光で蛍光体を光励起し可視光を得る.希ガスを用い ることで光源が水銀レスとなることに加え、PDPで実証 したように大型化が容易であることから、面積を広くす ることで高い出力を得られることが期待できる.

提案する紫外光光源の構造を第1図に示す.紫外光光 源は、スペーサを介して前面板と背面板をフリットガラ スで溶着し、放電空間を形成する、放電空間には、ネオ



第1図 紫外光光源の構造

Fig. 1 Structures of ultraviolet light source

ン(Ne)とキセノン(Xe)を混合した放電ガスを封入す る.前面板には、櫛(くし)形状の電極を形成し、その 電極を覆うように誘電体を形成する.背面板には、真空 紫外光を透過できる材料を用いる.深紫外光光源におい ては、放電ガスにより発生する真空紫外光を深紫外光に 波長変換する蛍光体を背面板に形成する.

紫外光光源の動作原理を以下に説明する. 隣接する電 極に極性が異なる電圧を印加することで, 誘電体を介し た放電空間に面放電が発生する. この放電により放電ガ ス中のXeが励起され, 基底状態に戻る際に147 nmと172 nmの真空紫外光が生じる. 真空紫外光光源は, この真空 紫外光を背面板側へ放出し, 深紫外光光源は, 真空紫外 光を光源内部に設けた蛍光体で波長変換した深紫外光を 背面板側へ放出する.

PDPの可視光発光原理を紫外光光源に応用するために は、課題が2点ある.1点目は背面板の材料が紫外光を透 過する必要があるために、現在使用しているガラス基板 が使用できないこと、2点目は発光層の材料として現在使 用している可視蛍光体が使用できないことである.以下 に、これらの課題に対する検討内容を示す.

2.2 背面板材料の検討

第1図記載のデバイス構成要素は、紫外光光源を実現 するために次の2つの仕様を満たす必要があった.1つ目 は前面板を電極や誘電体との熱特性を合わせるためにガ ラス材料とすることである.2つ目は放電空間に不純ガス が混入することを防ぐために前面板と背面板を熱プロセ スにより溶着するが、その際に気密性を保つことができ る前面板と背面板の材料を組み合わせることである.

筆者らは、一般的に紫外光透過材料として使用される 石英と、高価であるが短波長の紫外光を透過するサファ イアを選んだ.およそ500 ℃の熱プロセスを経てガラス 基板と候補材料を溶着した結果、石英ではクラックが生 じたが、サファイアはクラックを発生させずに密閉した 放電空間を形成できた.

この要因としては、従来のフリットガラスとガラス基 板の熱膨張係数がおよそ70×10⁻⁷ / Cに対して、石英が6 ×10⁻⁷ / Cと1桁小さく、サファイアはガラスと近い50~ 70×10⁻⁷ / Cであるためと考えている。各構成材料との熱 膨張係数差が小さいサファイアは熱プロセスによる残留 応力が生じにくく密閉空間が維持できる。

以上の検討から,紫外光光源の背面板材料にサファイ アを用いることで,紫外光を透過しつつ気密性の高い放 電空間を実現した.

2.3 発光材料の検討

筆者らは,PDPの放電制御用に開発された酸化マグネ シウム(MgO)粉体が真空紫外光の励起により紫外発光 する知見を得ており[6],深紫外光光源用の蛍光体として 使用する検討を行った.

MgO粉体は、水酸化マグネシウムの原料、焼成条件お よびフラックスに用いるフッ素 (F) の量により、紫外 光の強度が変化することがわかっていたが、発光サイト が不明であったために発光強度の制御が困難であった. そこで、第一原理計算を用いてMgO粉体の発光サイトの 明確化に取り組んだ結果, Mgと酸素欠陥およびドープさ れたFからなる複合欠陥が、(001)面の第1原子層に形成さ れた時のみ、紫外領域で発光することがわかった.これ を基に、FがMgO粉体に積極的にドープされるように焼 成プロセスを変更してMgO粉末を作製し、発光強度の測 定を行った.励起光に146 nmのエキシマランプを用い, マルチチャンネル分光器で測定を行った.また、一般的 な可視蛍光体と発光特性を比較するため、PDPで用いて いる青色蛍光体材料(BaMgAl₁₀O₁₇:Eu²⁺, BAM)を同時 に測定した. 焼成プロセス変更前後のMgO粉体とBAMの 発光スペクトルの測定結果を第2図に示す.第2図から、 MgO粉体の発光スペクトルは、232 nmを中心波長とした 半値幅40 nmのブロードな発光をもち、焼成プロセスを 変更することで、従来のMgO粉体よりも発光強度が3.5 倍上昇することがわかる.同時に測定したBAMの量子効 率が80%~90%であることから、焼成プロセスを変更し たMgO粉体の量子効率は、約50%であると見積もること ができる.

以上の検討から,MgOの発光原理を解析した計算結果 を基に焼成プロセスを変更し,量子効率の高いMgO粉体 の深紫外蛍光体を実現した.



第2図 MgO粉体とBAM蛍光体の蛍光スペクトル Fig. 2 Fluorescence spectra of MgO powders and BAM phosphor

2.4 試作

提案した紫外光光源の試作を行った.背面板は50 mm 角,厚み0.5 mmのサファイア基板を用い,前面板は40 mm ×60 mm, 厚み1.8 mmのガラス基板を用いた. ガラス基 板の表面に,銀ペーストを用いて幅1 mm,ギャップ1 mm の1対の櫛型電極を形成して焼成した.その上に誘電体の ガラスペーストを塗布して焼成した.次に,深紫外光光 源のみに背面板上に蛍光体を形成し,2枚の基板間に厚さ 1 mmのスペーサを配置して,周囲をシールフリットで溶 着し,25 mm角の放電空間を形成した.放電空間内にはNe (95%) -Xe (5%)の混合ガスを封入した.

2.5 特性

第3図に真空紫外光光源の点灯状態を,第4図に真空紫 外分光器と分光用検出器で測定した真空紫外光光源の発 光スペクトルを示す.



第3図 真空紫外光光源の点灯状態 Fig. 3 Lighting state of vacuum ultraviolet light source



第4図 真空紫外光光源の発光スペクトル

Fig. 4 Emission spectrum of vacuum ultraviolet light source

真空紫外光光源の発光スペクトルは、147 nmにXeの共 鳴線のピーク、172 nmに分子線のピークが見られる.

次に、第5図に深紫外光光源の点灯状態を示す。

深紫外測定用積分球にて測定した発光スペクトルを第 6図に,発光強度を第7図に示す.

発光スペクトルは,発光中心が232 nmで半値幅が40 nm のブロードな発光スペクトルであった.発光強度は,電 E,および印加する交流電圧の周波数に合わせて可変であり、45 kHzで500 Vの矩(く)形波を印加した場合、約5 mW/cm²であった。



第5図 深紫外光光源の点灯状態 Fig. 5 Lighting state of deep ultraviolet light source



第6図 深紫外光光源の発光スペクトル

Fig. 6 Emission spectra of deep ultraviolet light source and low-pressure mercury lamp



第7図 深紫外光光源の発光強度

Fig. 7 Emission intensity of deep ultraviolet light source

3. 紫外光の効果検証

3.1 殺菌効果の確認

 MS2に対する殺菌効果を一般的に殺菌光源として用いら れる低圧水銀ランプと比較した.

各大腸菌ファージは、液体培地中で高濃度に調製した ウイルスをリン酸緩衝液で10000倍希釈して試料とした. 殺菌処理は,試料の10 cm上方から深紫外光光源と低圧水 銀ランプを任意の時間照射した.各光源には、5 cm²の開 口を設けたマスクを設け、同面積での発光とした.紫外 光照射量は,KI/KIO₃化学光量計によって測定を行い、サ ンプルに照射されるおおよその照度は、深紫外光光源が 50 µW/cm²,低圧水銀ランプが190 µW/cm²であった.殺 菌効果を示す残存率の測定は重層寒天培地法によりプラ ックの測定で行った[7].

KI/KIO₃化学光量計によって測定した深紫外光光源と 低圧水銀ランプにおける紫外光照射量と残存率の関係を 第8図に示す.紫外光照射量は,照射強度 [mW/cm²] と照 射時間 [s] の積であり,同じ紫外光照射量による残存率 の差が紫外光の波長による殺菌効果の差と考えられる. 第8図から, ϕ X174 に対しては低圧水銀ランプの方が深 紫外光光源より殺菌効果が大きいが,MS2では深紫外光 光源の方が大きくなる.これは,菌ごとに殺菌効果の紫 外光波長感度が異なる[8]ことが原因と考えられる.





以上の結果から,深紫外光光源のもつ232 nmの発光波 長においても,低圧水銀ランプの254 nmと同程度の殺菌 効果をもち,また低圧水銀ランプよりも殺菌効果が優れ る菌が存在することがわかった.

3.2 分解効果の確認

開発した2種類の光源について有機物の分解効果を確認するため、有機物の色素であるインジゴカルミンを用いて光分解効果を確認した.

実験は、200 ppmに薄めたインジゴカルミン水溶液を φ32 mm、深さ10 mmのシャーレに入れ、攪拌(かくは ん)子で攪拌しながらシャーレの上部から紫外光を水溶 液に所定の時間照射した.今回開発した2つの光源の比較 のために,25 mm角のマスクを介した低圧水銀ランプと オゾンランプ(発光波長185 nmおよび254 nm)を用いた. 深紫外光光源および低圧水銀ランプの発光強度は,深紫 外光光源が4.8 mW/cm²,低圧水銀ランプが6.6 mW/cm²で あった.また,オゾンランプは185 nmと254 nmの紫外光 が出ているが,測定値を保証した測定器を所有していな いため,172 nm用照度計で測定し参考値とした.測定値 は40.5 mW/cm²であった.

各光源の紫外線照射後に水溶液中に残存するインジゴ カルミンおよび分解されることで生成した中間生成物の 量の時間推移を液体クロマトグラフィ質量分析法で測定 した.インジゴカルミン,中間生成物および硫酸水素イ オンの時間変化を**第9**図の(a),(b)および(c)に示す.



第9図 LC/MSによる同定結果

(a) インジゴカルミン, (b) 中間生成物, (c) 硫酸水素イオン

- Fig. 9 Results of identification by LC/MS
 - (a) Indigo carmine, (b) Intermediate product,
 - (c) Hydrogen sulfate ion

第9図(a)の結果から、すべての光源の紫外光照射に よりインジゴカルミンが分解されることがわかる.また、 第9図(b)の結果から、インジゴカルミンが分解して生 成したとみられる中間生成物は、いずれの光源の紫外光 照射でも増加するが、真空紫外光光源のみ増加後すぐに 減少する.これは、この中間生成物が真空紫外光光源の みで再び分解されたためと考えられる.第9図(c)は、 有機成分をすべて分解することで最終的に残留する硫酸 水素イオンの推移を示しているが、真空紫外光光源のみ で増加している.

以上の結果から,すべての光源の紫外光でインジゴカ ルミンを分解できるが,真空紫外光光源はより低分子ま で分解できることがわかった.

3.3 真空紫外光光源の分解性能

前記の分解実験において,真空紫外光光源は30分程度 の照射によりシャーレ内部に気泡が発生した.この気泡 の成分をガスクロマトグラフィにて測定した結果,二酸 化炭素(CO₂)であった.これはインジゴカルミンの有 機成分が気体であるCO₂に分解された結果と考えられる. そこで,有機成分の分解能力を定量的に調べるために残 留炭素分析を行った.紫外線照射前の溶液と,オゾンラ ンプおよび真空紫外光光源を各4時間照射した溶液の分 析結果を**第10**図に示す.



Fig. 10 Results of residual carbon analysis

第10図から,真空紫外光光源は4時間で67.1%の有機成 分をCO₂に分解した.一方,同じく真空紫外光を発する オゾンランプは4.1%しか分解していない.2.2節で示し た172 nm用照度計の測定結果や第9図(a)においてオゾ ンランプの減少傾向が最も大きいことから,光源の発光 強度は真空紫外光源よりオゾンランプの方が大きいと考 えられる.しかし,残留炭素分析の結果では,真空紫外 光光源の方がオゾンランプより分解性能が高い.この要 因の考察を以下に示す.

第1表に各種化学結合の結合解離エネルギーを示す[9]. インジゴカルミンの分子構造は,第9図(a)に示したように炭素の1重結合および2重結合が主であり,第1表から1重結合の解離結合エネルギーが約400 kJ/mol, 2重結合 が約700 kJ/molであることがわかる.一方,オゾンランプ が発する185 nmの真空紫外光が647 kJ/mol,真空紫外光源 の147 nmが814 kJ/molのエネルギーに相当するため,オゾ ンランプは炭素の2重結合を解離させるために必要なエ ネルギーをほとんどもっていないことがわかる.このた め,オゾンランプの真空紫外光は,中間生成物である第 9図 (b) に存在するベンゼン環を分解することがほとん どできず,有機成分をCO₂まで分解することができない と考えられる.

第1表 各種化学結合の結合解離エネルギー[9] Table 1 Bond dissociation energy of various chemical bands[9]

			[KJ/mol]
H−CH ₃	434	F−CH ₃	452
$H-C_2H_5$	412	F−CF ₃	543
CH ₃ -CH ₃	368	CF ₃ -CF ₃	410
$CH_3 - C_2H_5$	357	H-(CH=CH ₂)	455
CH₃-OH	383	H−(C≡CH)	500
CH ₃ -OCH ₃	342	$H-C_6H_5$	460
$C_2H_5 - OC_2H_5$	322	CH ₃ -(CHCH ₂)	466
CH ₃ -COCH ₃	355	CH₃−(C≡CH)	465
CH₃-COOH	403	$C_6H_5-CH_3$	417
CH₃CO−OH	448	$C_6H_5-C_6H_5$	468
$CH_3COO-C_2H_5$	360	C ₆ H₅−OCH ₃	409
$CH_3CO - OC_2H_5$	364	CH ₂ =CH ₂	718
CH ₃ CO-NH ₂	368	CH≡CH	960

4. まとめ

水銀レスで高い出力をもつ殺菌用の紫外光光源を実現 するため、PDPで用いられる面バリア放電を用いた新し い紫外光光源の開発を行った.真空紫外光光源は,147 nm と172 nmの真空紫外光を放出する.深紫外光光源は,中 心波長232 nm,半値幅40 nmの深紫外光を放出し,その 発光強度は,45 kHzで500 Vの矩形波を印加した場合,約 5 mW/cm²であった.

深紫外光光源の殺菌効果を確認するため、水銀ランプ と深紫外光光源の紫外光を大腸菌ファージφX174 と MS2に照射し,殺菌効果を評価した.この結果から,開 発した紫外光光源が殺菌光源として利用できることを示 した.また,同じ光量を菌に照射した場合,菌の種類に よって低圧水銀ランプよりも高い殺菌効果を得ることが わかった.

さらに,真空紫外光光源と深紫外光光源の物質分解効 果を確認するため,有機物であるインジゴカルミンに各 光源の紫外光を照射し,分解効果を評価した.開発した 真空紫外光光源は,他種の紫外光光源よりも高い分解性 能を示し,紫外光を4時間照射することで7割近い炭素成

分をCO2に分解した.

今後は、平面型のため保守が容易で、大面積化により 出力の向上が見込めるこれらの光源を用いて、社会課題 となっている強毒性の菌に対する殺菌効果の検討や難分 解物質の分解効果の検討を行う予定である.

参考文献

- [1] 浦島邦子,"世界における上下水道処理技術と水道業民営化の動向,"科学技術動向,2003年10月号, pp.14-20.
- [2] H.Huang, et al., "Enhanced photocatalytic degradation of methylene blue under vacuum ultraviolet irradiation," Catalysis Today, vol. 201, pp. 189-194, Mar. 2013.
- [3] 丸田晃三, "UVフィールドエミッションランプ," IWASAKI テクニカルレポート, http://www.iwasaki.co.jp/tech-rep/ technical/113/,参照 Apr. 19. 2017.
- [4] Hideki. Hirayama et al., "222-282 nm AlGaN and InAlGaN based deep-UV LEDs fabricated on high-quality AlN on sapphire," Phys. Status Solidi A 206, no. 6, pp.1176-1182, 2009.
- [5] K. Oguma et al., "Application of UV light emitting diodes to batch and flow-through water disinfection systems," Desalination, vol. 328, pp. 24-30, Nov. 2013.
- [6] M. Sakai et al., "High-Intensity Deep-UV Radiation and Exo-Electron Emission of MgO Powders for AC PDPs," Proceedings of the 21st International Display Workshops, Society for Information Display, Niigata, pp. 605-608, 2014.
- [7] (社)日本化学会(編),実験化学講座29 バイオテクノ
 ロジーの基本技術,第5版,丸善(株),東京,pp.104-105,2006.
- [8] S. Verhoeven et al., "Bacillus Pumilus as a High-Resistance Surrogate for High-Dose UV Reactor Validation," IUVA News vol. 15, no. 3, pp. 10-17, 2013.
- [9] 柿本雅明他,耐熱性高分子電子材料,(株)シーエムシー 出版,東京, p. 6, 2003.

執筆者紹介



佐々木 良樹 Yoshiki Sasaki 先端研究本部 光応用プロジェクト室 Applied Photoelectronics Research Lab., Advanced Research Div.





先端研究本部 材料・デバイス研究室 Materials and Devices Research Lab., Advanced Research Div.

頭川 武央



黒澤 貴子 Takako Kurosawa 先端研究本部 基盤技術研究部 Fundamental Technology Research Department, Advanced Research Div.

Takehiro Zukawa



長尾 宣明 Nobuaki Nagao 先端研究本部 材料・デバイス研究室 Materials and Devices Research Lab., Advanced Research Div. 工学博士



神子 直之 Naoyuki Kamiko 立命館大学 理工学部 環境システム工学科 Department of Environmental Systems Engineering, College of Science and Engineering, Ritsumeikan University 工学博士